



Patent Number:

JP4064466

Publication date:

1992-02-28

Inventor(s):

TAKADA HIDEAKI

Applicant(s)::

**CANON INC** 

Requested Patent:

□ JP4064466

Application Number: JP19900175288 19900704

Priority Number(s):

IPC Classification:

B41J13/02; B65H5/06

EC Classification:

Equivalents:

# **Abstract**

PURPOSE:To ensure an accurate image all over a sheet material by a method wherein during the feeding of the sheet material, at least in one pair out of a plurality of feed roller pairs, the force of the pressurizing roller is changed.

CONSTITUTION: In the state that a cam 18 presses up a spring hooking plate 17, the length of a spring 16 is increased, and the pressing force of an upper first feed roller 7b is large. At this time, the clamping force of a first feed roller pair 7 to a sheet material 2 is set to be larger than that of a second feed roller pair 12. In the state that the cam 18 is rotated to dispose the spring hooking plate 17 on its lowerest position, the length of the spring 16 is decreased, and the pressing force of the upper first feed roller 7b is reduced. At this time, the clamping force of the first feed roller pair 7 to the sheet material 2 is set to be smaller than that of the second feed roller pair 12.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

Û

SP-1038 US

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特 許 出 顧 公 告

#### 平5-64466 許 公 報(B2) ⑫特

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

**200**公告 平成5年(1993)9月14日

H 01 L 27/146 H 04 N 5/335

4228-5C U 7210-4M

H 01 L 27/14

発明の数 3 (全11頁)

❷発明の名称

光学的固体装置

昭58-182775 即特 **9** 

開 昭60-74673 ❸公

頤 昭58(1983)9月30日 29出

@昭60(1985) 4月26日

田 @発 明 者 原

엹

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 東京芝浦電気株式

会社総合研究所内

保 久 何発 穴

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 東京芝浦電気株式

会社総合研究所内

株式会社東芝 の出 頭 人

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

外2名 弁理士 鈴江 武彦 10代理 人

官 審査

春喜 内 野

特開 昭59-158553 (JP, A) **多**参考文献

1

2

# の特許請求の範囲

1 透明基板の上面側に設けられそのゲートをア ドレス線に接続されると共に、そのソースをデー タ線に接続されたMOSトランジスタと、上記基 板の上面側に設けられその一方の電極を上記トラ ンジスタのドレインに接続されたコンデンサと、 上記トランジスタ及びコンデンサの上面側に透明 絶縁層を介して被着され上記ドレインに接続され た不透明導体層、該導体層上に形成され電圧印加 料層上に被着された透明導体層からなる表示用セ ルと、前記基板上面側からの光を基板下面側に入 射せしめる窓部と、前記基板の下面に被着された 反射防止膜とを有し、前記トランジスタのチヤネ 一方を光導電膜で形成してなり、かつ前記トラン ジスタ、コンデンサ、表示用セル及び窓部からな る固体セルを前記基板上に複数個配置してなる光 学的固体装置において、前記窓部を介して前記基 きの被写体からの反射光により前記コンデンサに 蓄積される信号電荷を外部に画像信号として取出 す第1の撮像手段と、この撮像手段により取出さ れた画像信号を該信号が小さい場合は前記表示用

セルの透過率を低くし、かつ該信号が大きい場合 は上記透過率を高くする信号電圧に変換しこの信 号電圧を上記撮像した際の同一の表示用セルに印 加する駆動手段と、この駆動手段により上記電圧 を印加した状態で第1の撮像と同様に第2の撮像 を行う第2の撮像手段とを具備したことを特徴と する特徴とする光学的固体装置。

2 透明基板の上面側に設けられそのゲートをア ドレス線に接続されると共に、そのソースをデー により光の透過率が可変する表示材料層及び該材 10 タ線に接続されたMOSトランジスタと、上記基 板の上面側に設けられその一方の電極を上記トラ ンジスタのドレインに接続されたコンデンサと、 上記トランジスタ及びコンデンサの上面側に透明 絶縁層を介して被着され上記ドレインに接続され ル部分及び前記コンデンサの誘電層の少なくとも 15 た不透明導体層、該導体層上に形成され電圧印加 により光の透過率が可変する表示材料層及び該材 料層上に被着された透明導体層からなる表示用セ ルと、前記基板上面側からの光を基板下面側に入 射せしめる窓部と、前記基板の下面に被着された 板下面側に配置された被写体に光を照射しこのと 20 反射防止膜とを有し、前記トランジスタのチャネ ル部分及び前記コンデンサの誘電層の少なくとも 一方を光導電膜で形成してなり、かつ前記トラン ジスタ、コンデンサ、表示用セル及び窓部からな る固体セルを前記基板上に複数個配置してなる光

学的固体装置において、前記窓部を介して前記基 板下面側に配置された被写体に光を照射しこのと きの被写体からの反射光により前記コンデンサに 蓄積される信号電荷を外部に画像信号として取出 す第1の機像手段と、この機像手段により取出さ れ画像信号を該信号が小さい場合は前記表示用セ ルの透過率を低くし、かつ該信号が大きい場合は 上記透過率を高くする信号電圧に変換しこの信号 電圧を上記機像した際の同一の前記表示用セルに して設けられ上記駆動手段により表示用セルに印 加される電圧をそれぞれ記憶するメモリセルと、 上記駆動手段による電圧を印加した状態で第1の 撮像と同様に第2の撮像を行いこのとき得られる との差を画像信号として取出す第2の撮像手段と を具備したことを特徴とする光学的固体装置。

3 透明基板の上面側に設けられそのゲートをア ドレス線に接続されると共に、そのソースをデー 板の上面側に設けられその一方の電極を上記トラ ンジスタのドレインに接続されたコンデンサと、 上記トランジスタ及びコンデンサの上面側に透明 絶縁層を介して被着され上記ドレインに接続され た不透明導体層、該導体層上に形成され電圧印加 25 により光の透過率が可変する表示材料層及び該材 料層上に被着された透明導体層からなる表示用セ ルと、前記基板上面側からの光を基板下面側に入 射せしめる窓部と、前記基板の下面に被着された 反射防止膜とを有し、前記トランジスタのチャネ 30 において画像信号のコントラスト比及びダイナミ ル部分及び前記コンデンサの誘電層の少なくとも 一方を光導電膜で形成してなり、かつ前記トラン ジスタ、コンデンサ、表示用セル及び窓部からな る固体セルを前記基板上に複数個配置してなる光 板下面側に配置された被写体に光を照射しこのと きの被写体からの反射光により前記コンデンサに 蓄積される信号電荷を外部に画像信号として取出 す撮像動作に際し、前記表示用セルに印加する電 り大きく、かつ撮像により変化する上記表示用セ ルの電位が飽和蓄積信号電位に達する前に上記表 示用セルの透過率が減少する値に設定してなるこ とを特徴とする光学的固体装置。

# 発明の詳細な説明

#### 〔発明の技術分野〕

本発明は、表示、撮像及びハードコピーの3つ の機能を備えた光学的固体装置の改良に関する。 〔発明の技術的背景とその問題点〕

従来、表示するだけ、摄像するだけ或いはハー ドコピーを得るだけの機能を満足する装置は各種 実用化されているが、これら3つの機能を兼ね備 えた装置は未だ実用化されていない。また、表示 印加する駆動手段と、前記各トランジスタに対応 10 装置においては、CRTのように表示面以外が大 部分を占めるものではなく、小形軽量化の必要性 から薄い基板上に表示回路を形成したパネル・デ イスプレイが最も要求されている。したがつて、 1枚のパネルで上述した3つの機能を実現できる 画像信号と上記メモリセルに記憶された信号電圧 15 装置が得られるならば、その装置は従来のものと 比して小形化、軽量化及びローコスト化が可能に なると考えられる。

しかしながら、1枚のパネルにおいて前記3つ の機能をそれぞれ独立したセルで個別に実現しよ タ線に接続されたMOSトランジスタと、上記基 20 うとすると、そのパネルは製造技術上大幅な高密 度化が必要となり、実質的に製造困難である。さ らに、それぞれの機能を別々のパネルで実現する 以上の難しさがあり、実用的でない。

# 〔発明の目的〕

本発明の目的は、1つのセルに3つの機能を持 たせて表示、撮像及びハードコピーを行うことが でき、小形化、軽量化及びローコスト化をはかり 得る実用性大なる光学的固体装置を提供すること にある。さらに、本発明の他の目的は、撮像動作 ツクレンジの増大をはかり得る光学的固体装置を 提供することにある。

#### 〔発明の概要〕

本発明の骨子は、スイツチング・マトリツクス 学的固体装置において、前記窓部を介して前記基 35 液晶表示装置の一画素と略同等の構造を有するも のを基本構成とし、その基板として裏面に無反射 膜を設けた透明基板を用いると共に、トランジス タのチャネル部分やコンデンサの誘電層の材料を 光導電膜で形成することにより、1つのセルに表 圧を上記表示用セルの透過率が略最大となる値よ 40 示、機像及びハードコピーの3つの機能を持たせ ることにある。

> すなわち本発明は、透明基板の上面側に設けら れそのゲートをアドレス線に接続されると共に、 そのソースをデータ線に接続されたMOSトラン

# 59/ 67

(3)

6

ジスタと、上記基板の上面側に設けられその一方 の電極を上記トランジスタのドレインに接続され たコンデンサと、上記トランジスタ及びコンデン サの上面側に透明絶縁層を介して被着され上記ド レインに接続された不透明導体層、該導体層上に 形成され電圧印加により光の透過率が可変する表 示材料層及び該材料層上に被着された透明導体層 からなる表示用セルと、前記基板上面側からの光 を基板下面側に入射せしめる窓部と、前記基板の 下面に被着された反射防止膜とを有し、前記トラ ンジスタのチャネル部分及び前記コンデンサの誘 電層の少なくとも一方を光導電膜で形成してな り、かつ前記トランジスタ、コンデンサ、表示用 セル及び窓部からなる固体セルを前記基板上に複 窓部を介して前記基板下面側に配置された被写体 に光を照射しこのときの被写体からの反射光によ り前記コンデンサに蓄積される信号電荷を外部に 画像信号として取出す第1の撮像手段と、この撮 い場合は前記表示用セルの透過率を低くし、かつ 該信号が大きい場合は上記透過率を高くする信号 電圧に変換しこの信号電圧を上記撮像した際の同 一の表示用セルに印加する駆動手段と、この駆動 と同様に第2の撮像を行う第2の撮像手段とを設

5

ここで、上記「……において」までの構成は本 発明者等が先に提案したもの(特願昭58-32430 号)であり、本発明はこの構成に上記の駆動手段 30 及び撮像手段を付加することにより、コントラス ト比及びダイナミックレンジの増大をはかつたも のである。

けるようにしたものである。

また本発明は、上記先願の構成において、前記 窓部を介して前記基板下面側に配置された被写体 35 照射せしめ、これによつて上記表示画像のハード に光を照射しこのときの被写体からの反射光によ り前記コンデンサに蓄積される信号電荷を外部に 画像信号として取出す第1の撮像手段と、この撮 像手段により取出された画像信号を該信号が小さ い場合は前記表示用セルの透過率を低くし、かつ 40 該信号が大きい場合は上記透過率を高くする信号 電圧に変換しこの信号電圧を上記機像した際の同 一の前記表示用セルに印加する駆動手段と、前記 各トランジスタに対応して設けられ上記駆動手段

により表示用セルに印加される電圧をそれぞれ記 憶するメモリセルと、上記駆動手段による電圧を 印加した状態で第1の撮像と同様に第2の撮像を 行いこのとき得られる画像信号と上記メモリセル に記憶された信号電圧との差を画像信号として取 出す第2の撮像手段とを設けるようにしたもので

さらに本発明は、上記の先願の構成において、 前記窓部を介して前記基板下面側に配置された被 10 写体に光を照射しこのときの被写体からの反射光 により前記コンデンサに蓄積される信号電荷を外 部に画像信号として取出す撮像動作に際し、前記 表示用セルに印加する電圧を上記表示用セルの透 過率が略最大となる値より大きく、かつ撮像によ 数個配置してなる光学的固体装置において、前記 15 り変化する上記表示用セルの電位が飽和蓄積信号 電位に達する前に上記表示用セルの透過率が減少 する値に設定するようにしたものである。

#### 〔発明の効果〕

本発明によれば、前記アドレス線及びデータ線 像手段により取出された画像信号を該信号が小さ 20 の選択により所望の固体セルの表示用セルを駆動 し、これによつて通常の液晶表示装置と同様に画 像表示を行うことができる。また、表示用セルの 表示材料層を透明にした状態で、基板の下面側に 被写体を配置すると共に前記窓部を介して基板の 手段により上記電圧を印加した状態で第1の撮像 25 上面側から下面側に光を入射せしめることによ り、被写体の入射光による反射像を前記トランジ スタのチャネル部分や前記コンデンサの誘電層等 で受光し、これにより生じたコンデンサの電極間 電位変化分を検知することによつて被写体の撮像 を行うことができる。さらに、所望の固体セルの 表示用セルを駆動して画像表示を行つた状態で、 基板の下面側に感光紙を配置すると共に、基板の 上面側に光を均一照射することにより、表示用セ ルの表示材料層で透過率変調された光を感光紙に コピーを得ることができる。しかも、駆動手段や 電位設定手段等により撮像時の画像信号のコント ラスト及びダイナミックレンジを増大することが できるので、SNの高い撮像を行うことができる。 このように表示、撮像及びハードコピーの3つ の機能を実現することができ、装置構成の小形化 をはかり得、かつローコスト化にも有効である。 そしてこの場合、上記3つの機能を1つの固体セ ルに持たせることができ、さらに固体セルの構造

特公 平 5-64466

. .7

を比較的簡易なものとすることができるので、製. 造技術上の観点から見ても十分に実用性の高いも のである。

# 〔発明の実施例〕

第1図は本発明の第1の実施例に係わる光学的 固体装置の一画素構成を示す等価回路図である。 MOSトランジスタ1のゲート2はアドレス線3 に接続され、ソース4はデータ線5に接続され、 さらにドレイン 6 は結晶材料からなる液晶セル 号電荷を注入するためのコンデンサ8に接続され ている。そして、この一画素部分9は第2図に示 す如くパネル10上にマトリツクス状に多数個配 列されるものとなつている。

ここで、上記第1図の等価回路は周知のスイツ 15 デンサ8の誘電層16を形成した。 チング・マトリックス液晶表示装置の一画素回路 と同じである。本実施例装置がスイツチング・マ トリツクス液晶表示装置と異なる点は、前記コン デンサ8の誘電層を高抵抗光導電膜で形成すると に液晶セルを通過した光を外部に導光できる構造 としたことにある。

このような構造で画像表示を行うには、光がコ ンデンサ8の誘電層に入射されない状態とし、ア 晶セル7を駆動すればよい。これは、通常の液晶 表示装置と同じ操作である。また、撮像を行うに は、まずデータ線5からの前記液晶セル7とコン デンサ8との接続端子Pに所定のリセツト電圧を 印加し、その後トランジスタ1を任意の期間 30 OFFして端子Pを電気的にフローテイング状態 とする。この状態で被写体からの反射光をコンデ ンサ8の誘電層に入射させると、該誘電層に形成 された照射光量に比例した電荷が端子Pに注入さ れ、端子Pの電位は入射光量に依存して変化す 35 層) 2.1を被着し、この導体膜2.1に光透過用の る。この変位電位を検出すれば、入射光信号の検 出が可能となり、被写体の撮像が可能である。一 方、ハードコピーを行うには、前記画像表示を行 つた状態で液晶セル7に光を照射し、液晶セル7 を介した光を感光紙に入射すればよい。

次に、前記一画素に相当する固体セルの具体的 構造を説明する。第3図は上記セル構造を示す断。 面図であり、第4図a~cはその製造工程を示す。 断面図である。まず、第4図aに示す如くガラス

基板(透明基板)11上にMoやAI等からなる第 1の導体膜12を選択形成し、全面にCVD-SiOz膜からなる透明な第1の絶縁膜13を被着 した。ここで、導体膜12は前記トランジスタ1 のゲート2をなすものであり、絶縁膜13はトラ ンジスタ1のゲート酸化膜をなすものである。次 いで、第4図bに示す如く絶縁膜13上にIn<sub>2</sub>O<sub>2</sub> のような透明導体からなる第2の導体膜14を選 択形成した。ここで、導体膜14は前記コンデン (表示用セル) 7とデータ線5から注入された信 10 サ8の一方の電極をなすものである。続いて、全 面に光導電性を有する高抵抗のアモルフアスSi膜 をパターニングして該Si膜を前記第1及び第2の 導体膜 1-2, 14上に残存せしめた。これによ り、トランジスターのチャネル部分15及びコン

8

次いで、第4図cに示す如く全面に導体膜を被 着し、この導体膜をパターニングして第3の導体 膜17a,17bを形成すると共に光透過用の第 1の窓部18を形成した。ここで、導体膜17a 共に該光導電膜に光を照射できる構造とし、さら 20 は前記データ線5に接続され、前記ゲート2をな す第1の導体膜12は前記アドレス線3に接続さ れるものとなつている。導体膜17bは前記コン デンサ8の他方の電極をなすものである。また、 チヤネル部分15及びゲート12等からなる ドレス線3及びデータ線5の選択により所望の液 25 MOSトランジスタ1は、薄膜に形成したいわゆ るスタガードタイプの薄膜トランジスタである。 なお、第4図c中19a,19b,19cは、導 体膜とアモルフアスSi膜との接触抵抗を下げるた めのオーミツク層をそれぞれ示している。

> 次いで、第4図 d に示す如く全面に透明材料か らなる第2の絶縁膜(透明絶縁層)19を被着 し、この絶縁膜19の前記第3の電極17b上に コンタクトホール20を形成した。続いて、第4 図eに示す如く全面に第4の導体膜(不透明導体 第2の窓部22を形成した。ここで、導体膜21 は前記液晶セル7の一方の電極をなすものであ る。これ以降は、通常の液晶表示装置と同様に、 第3図に示すように第1配向層23、液晶層(表 40 示材料層)24、第2配向層25、第5の導体膜 (透明導体層) 26、ガラス板27及び偏光層2 8を上記順に積層形成し、さらに基板 1 1 の下面 に光学的反射防止膜29を被着することによつ て、固体セルが得られる。かくして得られた固体

セルは前記第2図に示した一画素9に相当し第5 図に示す如く基板11上にマトリックス配置され るものとなつている。なお、第5図中40,, ~,~ 40 nはそれぞれ上記固体セルに相当し、30は 基板11の下面に密着若しくは近接配置される被 5 写体、30aは黒部、30bは白部を示してい る。

次に、上記構造の固体セルをマトリツクス配置 してなる本装置の作用について説明する。

まず、撮像を行う場合、前記第3図および第5 図に示す如く文字や数字等が書かれた紙等の被写 体30をガラス基板11の下面に密着配置する。 この状態で基板11の上面側に光を照射すると、 前記窓部18,22から基板11内に光が入射す 11の下面に密着配置した被写体30で反射さ れ、その反射光 (図中1点鎖線Rで示す) が前記 第1の絶縁膜13及び第2の導体膜14を通過し てコンデンサ8の誘電層16であるアモルフアス Si膜に照射される。そして、誘電層 1 6 内には上 20 記反射光量に応じた電子及び正孔対が形成され る。ここで、予めトランジスタ1をONしてお き、液晶層24として例えばゲストホスト (GH)型を用いるならば、前記フローテイング 端子Pである第3の導体膜17bに 6[V] 程度 25 の電圧を印加し、以後信号電荷蓄積期間中はトラ ンジスタ1をOFFにする。この状態で液晶層2 4は透明になつており、前記第2の導体膜14を 0[V]付近に設定しておけば、第3の導体膜 1 る。さらに、正孔は第2の導体膜14を流れ外部 に除去される。そして、第3の導体膜17bの電 位は注入電荷量に応じて下がる。

ここで、第3の導体膜17bに注入された信号 0からの反射光量に依存する。被写体30からの 反射光量は、被写体30に書かれた文字や数字等 の画像情報に依存する。このため、第3の導体膜 17 bに注入された信号電荷蓄積量は被写体30 電位減少分も上記画像情報に対応するものとな る。したがつて、信号電荷蓄積期間終了後、トラ ンジスタ1をONして新たにプリセット電圧を第 3の導体膜17bに印加し、このときデータ線5

10

(5)

に流れる充電電流を検出すれば、前記画像情報を 電気的に検出できることになる。つまり、個々の 固体セル401,~,40nで得られる信号電荷 蓄積量が判り、被写体30を撮像することが可能 となる。

また、画像表示を行う場合は、前記被写体30 をガラス基板11の下面に反射防止膜29が存在 することから、前記入射光Qは基板下面で反射す ることなく基板11の下方に透過する。第3図中 10 破線Sで示しているのがこの透過光である。この ため、前記反射光Rがコンデンサ8の誘電層16 に入射することはない。さらに、ガラス基板11 の下面側に例えば光吸収の大きな部材を配置する ことによつて、透過光Sの基板11へ再入射も阻 る。この入射光(図中1点鎖線Qで示す)は基板 15 止できる。したがつて、この伏態では前記アドレ ス線3及びデータ線5の選択により所望の固体セ ルの液晶セル7に表示信号電圧を印加することに よつて、画像表示を行うことができる。

一方、ハードコピーを行う場合、画像表示モー ド、つまり液晶セル7に所望の画像を表示した状 態で、前記被写体30の代りに感光紙をガラス基 板11の上面側に一様光を照射すると、液晶セル 7及び前記窓部22,18を介して基板11内に 光が入射し、この入射光Qが感光紙に照射される ことになる。ここで、液晶層24を通過した光は 液晶セル7の表示動作モードに従いその強度が可 変する。すなわち、前記入射光Qは液晶セル7の 表示動作モードに応じて光透過率変調されたもの となり、この光透過率変調された入射光Qが感光 7 bには電子が注入され信号電荷として蓄積され 30 紙に照射される。したがつて、感光紙を現像・定 着させると前記液晶セル7に表示されたパターン のハードコピーが得られるすなわち、プリンティ ングを行うことができる。

ここまでの構成及び作用は先願と同様であり、 電荷量は、信号電荷蓄積期間中における被写体3 35 本実施例が先願と異なる点は第6図に示す駆動回 路を設け撮像時におけるコントラスト及びダイナ ミツクレンジの増大をはかつたことにある。すな わち、駆動回路は第1の表示信号処理回路61、 第2の表示信号処理回路62、撮像用信号処理回 の画像情報に対応するものとなり、導体膜17b 40 路63及びスイツチ回路64から構成されてい る。第1の表示信号処理回路61は表示モードに おいて前記液晶セルイに表示用信号を印加するた めのものである。第2の表示信号処理回路62は **撮像モードにおいて前記液晶セル7に後述する表** 

12

示信号電圧を印加するためのものである。また、 撮像用信号処理回路63は撮像モードにおいて得 られた画像信号から該信号に応じた表示信号を得 るためのものである。なお、図中65は前記固体 TFT(Thin Film Transistor) パネルを示し、 66はそのドライバ回路を示している。

このような構成では、まず表示モードでは表示 信号が端子Xに印加され、この信号が第1の表示 イツチ回路64を介してパネル65の各セル40 1, ~, 40 nに印加される。また、撮像モード では、まず第1の表示信号処理回路61によりセ ル40<sub>1</sub>, ~, 40 n内の各液晶セルの透過率を 高い状態にして第1の撮像を行う。この場合、彼 15 像情報を得ることができる。 写体30表面の反射光強度に比例した電荷がセル 401, ~, 40 n内に発生し、そして蓄積され る。セル401, ~, 40 n内に蓄積された信号 電荷による信号電圧はスイツチ回路64を介して して出力される。この画像信号は第2の表示信号 処理回路62により表示用信号電圧に変換され、 スイツチ64を介してセル40,~40nに再 び印加される。ここで、第2の表示信号処理回路 の液晶セルの透過率を低くし、白部30b上の液 晶セルの透過率は高くする表示信号電圧を出力す る。これにより、白部30b上の液晶セルに入射 する光線の被写体30からの反射光は第1の撮像 に入射する反射光は液晶セルによつて下げられ る。例えば、液晶セルとしてツイステツド・ネマ テイツク(TN) 材料を用いるとその白黒コント ラスト比は30~40: 1 であるので、黒部30a実 面からの反射光強度は従来と比較して 1/30~40 35 例では第2の撮像時に液晶セルに印加した表示信 に減少する。この状態で第2の撮像を行い、画像 信号処理回路63から画像信号を出力する。かく して得られた画像信号は、そのコントラストが従 来の30~40倍増大することになる。したがつて、 従来黒部30a装面に光沢がある場合画像信号の 40 コントラスト比が劣化していたが、これにより大 幅に改善される。

このようにして本装置では、基本的な一画素等 価回路としては液晶表示装置のものと同様である

にも拘らず、表示は勿論のこと撮像及びハードコ ピーを行うこともできる。すなわち、本装置は従 --来の単なるデイスプレイ・パネルではなくディス プレイ、イメージング及びプリンティングの機能 セル401, ~, 40 n を複数個配列してなる 5 を備えたDIP(Display・Imaging・Printing) パ ネルである。そして、D・I・P機能をそれぞれ 独立に、またDとIの如く2つの機能を組合わせ て使用することもできる。また、1つの固体セル の集積度が従来の液晶表示装置の一画素分と略同 信号処理回路61で表示信号電圧に変換され、ス 10 程度でよく、さらに該セルの製作も現在の半導体 製造技術から容易であることから、本装置は十分 に実用性の高いものである。しかも、撮像時にお ける画像信号のコントラスト及びダイナミックレ ンジの増大をはかり得ることから、SNの高い画

次に、本発明の第2の実施例を説明する。この 実施例は先に説明した第1の実施例にメモリセル を付加し、第2の摄像により得られた画像信号と 第2の撮像時に前記固体セルに印加された表示信 撮像用信号処理回路63に入力され、画像信号と 20 号電圧との差を取るようにしたものである。すな わち、前記基板 1 1 には固体セル 4 0 1, ~, 4 0 nにそれぞれ対応して複数のメモリセルが設け られている。これらのメモリセルは第2の撮像時 に第2の表示信号処理回路62から出力される表 62では、入力した画像信号に基き黒部30a上 25 示信号電圧をそれぞれ記憶するもので、例えば MOSトランジスタ及びMOSキャパシタから形成 される。

このような構成であつても、先の実施例と同様 に撮像、表示及びコピーの3つの機能が得られる の場合と同じであるが、黒部30a上の液晶セル 30 のは勿論のことである。そしてこの場合、第2の 撮像により得られる画像信号とメモリセルに記憶 された信号電圧との差を画像信号として出力して いるので、画像信号のコントラストがより向上す るという効果がある。すなわち、先の第1の実施 号電圧と被写体からの反射光入射により変動した 電圧分との和を画像信号として取出しているが、 本実施例では上記変動分を画像信号として取出し ている。そして、この変動分には第2の撮像時に 液晶セルに印加した表示信号電圧による液晶セル の透過率変化が重畳されるので、第1の撮像によ -る変動分より大きいものとなり、したがつてより 高いコントラストが得られるのである。

次に、本発明の第3の実施例について説明す

(7)

14

る。この実施例が先の第1の実施例と異なる点 は、前記駆動回路を設ける代りに撮像時における 固体セルに印加する電圧、つまり液晶セルに印加。 する表示信号電圧を制御したことにある。すなわ ち、上記表示信号電圧を液晶セルの透過率が略最 5 大となる値より大きく、かつ撮像により変化する 上記セルの電位が飽和蓄積信号電位に達する前に 上記セルの透過率が減少する値に設定するように したものである。

示す模式図である。図に示すようにVtの上昇と 共に透過率が上がるようになつている。そして TFTセルに蓄積される信号電荷が電子とすると、 TFTセルへの光照射により前記Vtは減少し液晶 Va→Vb→Vc→Vdと変化する。本実施例では前 記第1の撮像動作においてTFTセルの設定電位 Vtが被写体30の表面白部39bからの反射光 により図中VbとVdとの間の電位、例えばVcま 設定する。すなわち、液晶セルの透過率で一定な 光透過率レベルである領域【の電位Vaに電位設 定し、TFTセルへの光照射により電位が減少し、 これに伴つて透過率が減少する領域Ⅱの電位Vc けるTFTセルに蓄積される信号電荷量Qsigの時 間変化は第7図bに示す如くなる。これに見られ るように時間Tbまではaの電位VaがVbまで変 化する期間で透過率が一定の期間である。透過率 そして、これ以上の時間では透過率が減少するた め、Qsigの増加分は減少する。そして、Taで TFTセルはこれ以上Qsigを蓄積できないレベル Qsatに達する。また、aの低透過率領域皿まで で示すように更にQsigの増加分が減少してQsat 到達時間はTcまで伸びる。このような状態では、 信号電荷を蓄積すべきTFTセルは飽和しており、 この部分の被写体表面からの反射光の周辺TFT なるが本実施例ではこの部分の液晶セルは低透過 率領域Ⅲに至つているため怪滅されることにな

第7図cはこの方式を用いた場合の画像信号

Vsigの被写体表面コントラスト【依存性を示す。 これに示されるようにコントラストlcまでは VsigはIに比例するが、これ以上で増加がなだ らかになる。すなわち、液晶セルの透過率が第1 の撮像時に常に領域【になるように設定した場合 の飽和コントラストレベルIbと比べIaまでのコン トラストを識別できるようになりダイナミツクレ ンジが拡大される。なお、以上の説明では、液晶 セルの透過率がTFTセルへの光照射により減少 第7図aは液晶透過率のTFT電位Vt依存性を 10 するものであればよく、信号電荷は正孔でもよい のは勿論である。

かくして本実施例によれば、先の第1の実施例 と同様の効果は勿論のこと、格別な駆動回路等を 設けることなく、撮影時における表示信号電位を セルの透過率が低下する。すなわち、Vtは図中 15 設定するのみで画像信号のコントラスト及びダイ ナミックレンジを増大し得る等の利点がある。

なお、本発明は上述した実施例に限定されるも のではない。例えば、前記コンデンサの誘電層と してのアモルフアスSi膜は、高抵抗を得るために で変化するように当初設定電位Vt(図中Va)を 20 アモルフアスSi膜のP-i構造としてもよい。さ らに、アモルフアスSi膜の代りには、光導電性を 持つ光導電膜であれば用いることができる。ま た、コンデンサの誘電層の代りに前記MOSトラ ンジスタのチヤネル部分を光導電膜で形成するこ まで変化するように設定すると、一定照射時にお 25 とも可能である。この場合、透明基板下面からの 反射光が上記チャネル部分に入射する構造とする と、チヤネル部分に形成されたキヤリアのエレク トロンがコンデンサに蓄積されることになり、コ ンデンサの誘電層を光導電膜で形成したのと同様 が一定であるためQsigはTに比例して増加する。30 な効果が得られる。さらに、上記誘電層及びチャ ネル部分を光導電膜で形成することにより、撮像 **感度の向上をはかることも可能である。また、ト** ランジスタ及びコンデンサの構造は前記第3図に 限定されるものではなく、使用に応じて適宜変更 Qsatに達する前にVtが低下するともの一点鎖線 35 すればよい。また、前記表示用セルの表示材料層 は液晶に限るものではなく、電圧印加によりその 光透過率が可変するものであればよく、例えばエ レクトロクロミツク材料を用いてもよい。さら に、前記配向層、偏光層、ガラス基板及び表示セ への拡散光は再生画像上のかぶりを生じることに 40 ル用導体層の構成や材料等も何等実施例に限定さ れるものではなく、使用に応じて適宜変更可能で ある。

> また、第1の実施例では2回の撮像により撮像 を行つたが、第2の撮像による画像信号を再表示

. 15

させて画質を更に向上させることも可能である。 さらに、第1の撮像信号を演算処理して再表示せ しめ第2撮像を行わしめてもよい。例えば、輪郭 強調処理、輪郭抽出処理、紙面汚れ補正処理等で で、種々変形して実施することができる。

# 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例に係わる光学的 固体装置の一画素構成を示す等価回路図、第2図 上記一画素に対応する固体セル構造を示す断面 図、第4図 a~eは上記固体セルの製造工程を示 す断面図、第5図は上記固体セルをマトリツクス 状に配置してなるパネルを示す断面図、第6図は 図a~cは第3の実施例を説明するための模式図 である。

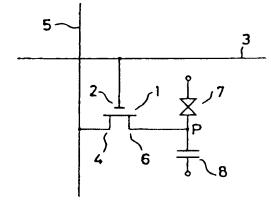
1 ······ MOSトランジスタ、2 ······ゲート、3

第1図

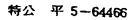


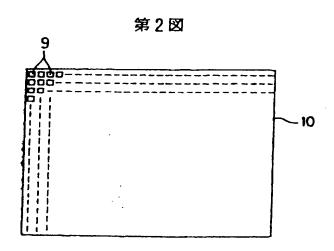
16

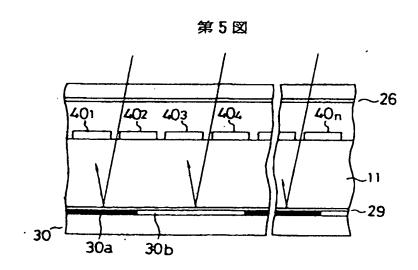
·····アドレス線、4 ·····ソース、5 ·····データ 線、6……ドレイン、7……液晶セル(表示用セ ·タレ)、8……コンデンサ、9……画素、10…… パネル、11……ガラス基板、(透明基板)、12 ある。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲 5 ……第1の導体膜、13……第1の絶縁膜、14 ·····第2の導体膜、15·····チャネル部分、16 ······誘電層、17a, 17b……第3の導体膜、 18,22……窓部、19……第2の絶縁膜(透 明絶縁層)、21……第4の導体膜(不透明導体 は上記一画素の配列状態を示す平面図、第3図は 10 層)、23,25……配向層、24……液晶 (表 示材料層)、26……第5の導体層(透明導体 層)、27……ガラス板、28……偏光層、29 ······反射防止膜、30·····被写体、40<sub>1</sub>,~, 40 n……固体セル、61……第1の表示信号処 上記固体セルの駆動回路を示すブロック図、第7 15 理回路、62……第2の表示信号処理回路、63 ……撮像用信号処理回路、 6 4 ·····スイツチ回 路、65……TFTパネル、66……ドライバ回 路。

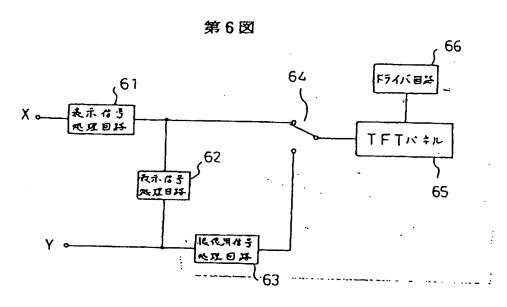


第3図 28 27 26 -25 24-17a 19 13 -11 R 29 <del>(~3</del>0



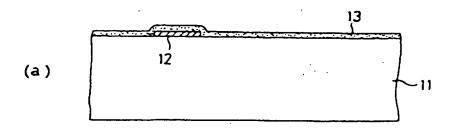


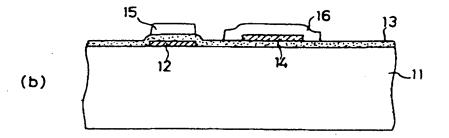


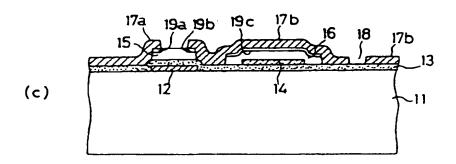


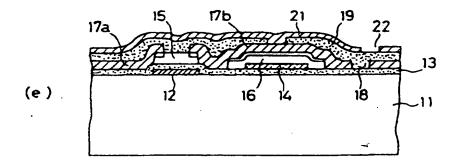
特公 平 5-64466

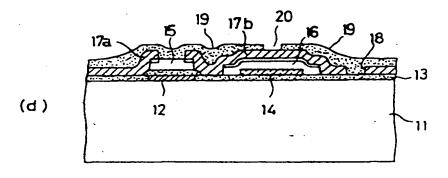
第4図











(11)

特公 平 5-64466

第7図

